

超景深3D合成测量显微镜

自动对焦

平面测量和
剖面高度测量

可旋转观察
3D 立体成像

可旋转工作台



- 相机自动对焦
- 相机内置马达, 自动超景深合成
- 可导出PDF报告
- 相机内置软件, 无需电脑, 通过鼠标键盘操作
- 可快速生成超景深图像
- 可平面测量和剖面高度测量

5324-K210



支架支持左右90°自由调节



5324-K220

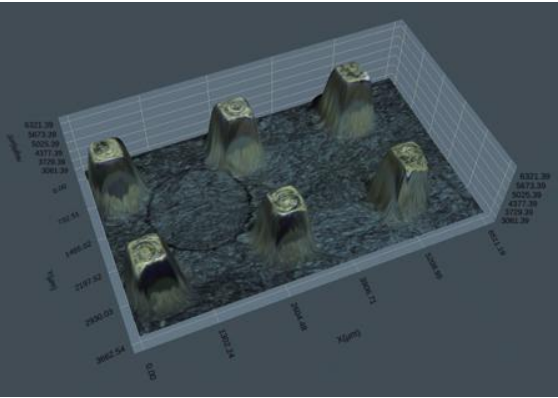
技术参数

型号	5324-K210	5324-K220
支架	垂直固定支架	倾斜支架
放大倍率	100X~750X	
传感器	1/2" CMOS	
像素	2M	
分辨率	1920×1080	
帧速率	60fps	
视场	0.6×0.32~4.5×2.5mm	
工作距离	30~40mm	
平面测量精度	±8μm	
输出接口	HDMI/LAN	
电源	电源适配器	
尺寸(长×宽×高)	570×300×430mm	340×300×695mm
重量	10kg	15.5kg

标准配置

型号	5324-K210	5324-K220
主机	1个	
校准块	1盒	
鼠标	1个	
键盘	1个	
显示器	1台	
16G U盘	1个	
玻璃校准尺	1个	
电源适配器	2个	
支架	1个	

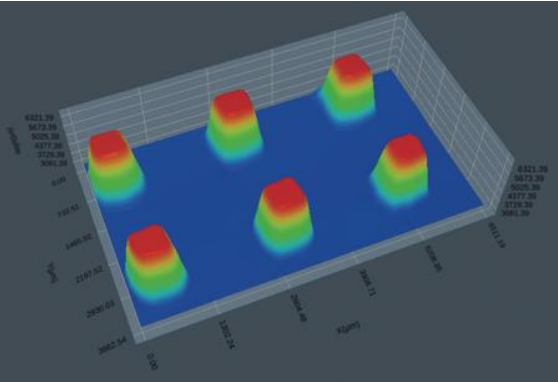
相机软件(标配)



利用景深合成技术, 构造三维立体图形, 图形可360°拖拽旋转观看



可在剖面上快速测量任意高度差



色谱高度图可清楚看到立体高度差

剖面高度测量精度

物镜倍率	测量范围	测量精度
1.5X	2000μm	±20μm
2X	1200μm	±10μm
2.5X	800μm	±10μm
3X	600μm	±6μm
3.5X	400μm	±5μm
4X	320μm	±5μm
4.5X	250μm	±5μm
5X	200μm	±3μm

* 不建议在0.75X和1X下测量剖面高度